

Libellé du poste : Technicien(ne) Métrologie CDSEM, AFM H/F

Caractéristiques du poste : CDD

Création ou Remplacement de : Création

Lieu de travail : Grenoble

Horaire de travail : Horaires posté alterné 1 semaine sur 2 matin / après-midi (5h-13h15 / 13h – 21h15).

Contexte/motif/enjeux du recrutement

Description de la Direction.

Le CEA LETI (Laboratoire d'Electronique et des Technologies de l'Information) à Grenoble est un des centres de recherche technologique leaders mondiaux en matière de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC). Sa mission première est de développer des solutions innovantes dans ses différents domaines de compétences et de les transférer à l'industrie dans le cadre de partenariats industriels, afin de répondre aux besoins de marchés à forte croissance.

Description de l'unité

Au sein du Département des Plateformes Technologiques, le Service de Métrologie et Caractérisation Physique (SMCP) a pour objectif de définir, développer et mettre en œuvre les équipements ou techniques de contrôle, métrologie, défektivité, et nano-caractérisation nécessaires aux programmes de recherche en micro et nanotechnologies (microélectronique, microsystèmes, photonique, ...).

Dans ce contexte, le Service doit maintenir ses effectifs pour faire face aux besoins croissants, en terme de métrologie et défektivité aux échelles micro et nanométrique, des technologies développées dans les salles blanches du CEA LETI.

Mission

Les besoins, dans le domaine de la métrologie dimensionnelle en salle blanche, nécessitent le recrutement d'un(e) technicien(ne) en CDD. Vous serez intégré(e) au secteur mesures dimensionnelles du Laboratoire de Microscopie, Mesures et Défektivité du SMCP et travaillerez en horaires d'équipe semaine.

Une formation sera réalisée par les experts du secteur ou les équipementiers sur les microscopes à force atomique (AFM) et les microscopes électroniques à balayage dédiés à la mesure des dimensions critiques (CD-SEM) de motifs nanométriques réalisés par photolithographie ou gravure sur les plaques de silicium de 200 ou 300 mm.

Vous serez ensuite directement impliqué dans:

- le **suivi** des performances de ces CD-SEM et AFM, le pré-diagnostic des pannes en lien avec les responsables équipements et l'équipe maintenance du Service
- la **création** et l'optimisation de programmes de mesures automatiques, l'interprétation des résultats obtenus en lien avec les ingénieurs du secteur et les équipes procédés ou filières technologiques
- la **mise à jour** des modes opératoires des CD-SEM et AFM
- la **formation** de nouveaux utilisateurs

Vous interviendrez également dans le cadre de développements spécifiques associés aux nouvelles fonctionnalités des équipements ou à l'établissement de protocoles de mesures originaux en lien avec les ingénieurs du secteur.

Profil recherché

Formation : Vous devrez être à minima titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2 (DUT, BTS) en physique, matériaux ou microélectronique. Vous maîtrisez l'anglais professionnel.

Expérience professionnelle souhaitée : première expérience en micro-électronique et caractérisation par microscopie électronique et/ou microscopie à force atomique de 3 à 5 ans.

Qualités adaptées : Le candidat devra faire preuve d'esprit d'équipe, d'autonomie, de rigueur et d'organisation.

Contacts :

Nicolas CHEVALIER (DPFT/SMCP/LASI) – nicolas.chevalier@cea.fr